

TEUS S-200 极紫外光源



产品特点

高亮度(意味着高吞吐量)以及出色的稳定性, 绝对 Min. 碎片, 很高的正常运行时间

产品型号

TEUS S-200

应用领域

掩膜及表面检查 模板检查(PMI) 区域掩模检验(AIMS) 掩模空bai检验(MBI)

极紫外光学链中的极紫外扫描仪检测 材料科学 晶片光刻检验

核心参数

激光平均功率	脉冲重复率	等离子体稳定性
200W	50kHz 或 135kHz(可调)	3% RMS

尺寸图



技术参数

主要技术参数

型号	TEUS S-200
激光平均功率	200W
脉冲重复率	50kHz 或 135kHz (可调)
可收集 EUV 功率的立体角	0.05s
等离子体尺寸* μm	≤ 60 或 ≤ 40
带内辐射转换效率(13.5 nm \pm 1%)	2%@ $2\pi\text{-sr}$ 或 1.6%@ $2\pi\text{-sr}$
EUV 碎片缓减系统后带内通量收集角(13.5nm \pm 1%)	22mW 或 18mW
碎片缓减系统后带内光谱亮度(13.5nm \pm 1%), W/mm ² ·sr	$\geq 160\text{W/mm}^2\text{-sr}$ 或 $\geq 280\text{W/mm}^2\text{-sr}$
等离子体稳定性	3%RMS

系统寿命和维护要求



型号	TEUS S-200
在 24/7 运行模式下, 不使用特殊膜过滤器, 收集器寿命下降 10%	不少于 4 个月
在全天候运行模式下, 使用特殊膜过滤器, 集热器寿命下降 10%	不少于 9 个月
维护间隔:	3 个月- 2 天
正常运行时间在全天候运行模式***	3 个月

电力, 系统尺寸和重量

型号	TEUS S-200
电功率	8.5kW
尺寸 (L×W×H)	1500×1000×1200 mm
重量, 包括激光部件	770 公斤

设备需求

型号	TEUS S-200
房间清洁度等级	ISO7
水流速率	10 升/分钟

